SEMICONDUCTOR DEVICE

PUB. NO.: 63-096946 [JP 63096946 A] PUBLISHED: April 27, 1988 (19880427)

INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) D.: 61-243615 [JP 86243615]

APPL NO.: 61-243615 [JP 86243615] FILED: October 13, 1986 (19861013)

INTL CLASS: [4] H01L-023/46; H01L-023/28; H01L-023/34

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 656, Vol. 12, No. 335, Pg. 65,

September 09, 1988 (19880909)

ABSTRACT

PURPOSE: To increase a withstand voltage between an electric route and a cooling route by a method wherein the electric route is insulated completely from the cooling route by inserting an insulating plate between an electric-current terminal and a cooling block and the whole device is sealed by an insulating material so that the dew condensation on the insulating plate can be prevented.

CONSTITUTION: The heat generated by a semiconductor device 1 is conducted from an electric-current terminal 2 installed on both faces of the device over an insulating plate 8 to a cooling block 3, and is discharged after the heat has been absorbed by cooling water. The efficiency of thermal conductivity is influenced only a little by the insulating plate 8, but is not worsened. Because the insulating plate 8 is installed, an electric route is insulated electrically from a cooling route, and the cooling water is not electrified. It is not required to control the water quality of the cooling water; the corrosion by an electric current is not caused. In addition, except for a connecting part 2a and a part 5a to conduct the heat to the outside, the whole assembly including a pressurizing structure 9 is insulated and sealed 10. As a result, it is possible to prevent the dew condensation on the insulating plate 8 and to increase the pressure—tight performance between the electric route and the cooling route it is,

therefore possible to obtain an ultra-high-voltage semiconductor device easily.

69日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

母公開特許公報(A)

昭63-96946

@Int_CI.4

量别定号

庁内整理番号

公公開 昭和63年(1988) 4月27日

H 01 L 23/46 23/28 23/34

客査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 半導体装置

> **29**14 駅 昭61-243615

母田 昭61(1986)10月13日

田 の発明 者

兵庫県伊丹市塔原 4 丁目 1 香地 三菱電機株式会社北伊丹

三菱電撥株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 増煌 外2名

込然により加圧技持して構成する準導作業業構造 において、前型名電流増子と冷却プロックとの被 圧温器に絶縁を介在、挿入させて、電気的に絶 歩 十 太 と 故に、 故記 太智 独 様子の 从 低 へ の 始 絶 低 分と、歯配各指揮プロックの外部への急促進部分 とも独立、かつ前記加圧構造器を含み、でんらの 全体を絶職対対により対止させて構成したことを 特徴とする学等体装置。

3、発明の詳細な説明

(点装上の料用分野)

この発明は、半退休表置に関し、さらに詳しく は、半導体素子の異難に電波線子。冷却プロック を順に登ね、加圧技持して構成する平準券装置機 直の改良に振るものである。

タ。それにトランジスタなどの半導体業子におい ては、発熱温度によりその特性が著しく変化しい かつ放為作用の悪い環境では、異常是為によつて 放坡する危険すらあるために、その対策として、 使来から放蕩手段を譲じた基々の手道体装置組立 が提案されている。カスコルルツ

従来例によるこの種の放蕩手歌を頭じた手幕体 並置として、ことでは太冷文学導作装置の構成を 節2番に示す。 こうりゅうちゅう

ナなわち、この節を顕使法何構成において、符 号し 比半導体書子。こゝではダイオードを示し、 2 はこの半導体素子1 の両端側に振した一分の電 並組子、2 比さらにこれらの非常連組子の外側に 配した油伝導性の良好な金属からなる一分の冷却 プロックで、それぞれの内部には、冷却水の水路 し がが求され、各本路にはご供講などの全異から なるホースニップル5 もねじ込みまたはロー付け により取付けると共に、一方のニップル5.5 買を



特開昭63-96946(2)

配管ホースI により連載させ、他力のニップル5。
1 を通して、矢印のように为却水を通水させ、 前配半導体第子1 の長地を、これら一対づいの電波 第子2.2 および冷却プロック3.3 を介して冷却し得るようにしてあり、また、7 は地球底で、 前配半導体第子1.4 電波増子2.2 および各冷却プロック3.2 を挟持して、矢印に示す圧被力を受けるようにすると共に、関示しない加圧構造器との電気的地球をとるようにしたものである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかして、前記的を選使を倒壊成での平準体験 誰における最大の無点とするところは、各階がプロック3.3 の水路4.4 が帯電されることにあり、 このために平準体室子1 の両値にからる電圧が、 そのまら配管ホース4.3 とび内部の指導水にも印 加されて、この指導水の拡牧が低いと、多くの液 れ電波が冷却緩路を流れ、特に直旋電圧がかけら れている場合には、ホースニップル5.5 が電波度 まで溶解。振純することがあつて、短期間で各階 類プロック3.3 が使用不能になるほか、このよう

変面前露によって電波が扱れる現金を発生しており、この点は、単に知識避難を延長させるだけでは解決し得ない問題であって、電気振路と冷却経路間の耐電圧にはおのずと要罪があり、これは半導体第子1の有する特性・定むを十分には活用し得ないことを意味していて、この種の複数検索にとって行ましくないものであった。

この発明は、使来のこのような問題点を振動するためになされたもので、その目的とするところは、 半導体第子の有する特性。定格を十分に発揮し界で、電視男会を発生せず、かつ適電事故の係れのない高階圧の半導体被置を提供することである。

(問題点を解決するための手段) ・

教記目的を達成するために、この発明に係る事業体裁製は、電流電子と内部プロッタとの被圧器 関に地域数を分を、挿入させると共に、加圧構造 業を含めた装置全体を地級対抗で対止させたもの である。

(作用)

に冷却水の気状が低いと、感電の気化すらあつて 危険であり、これを防止するためには、冷却水の 気状を可及的に高くする必要があつて、その水質 の管理も容易でないなどの不利がある。

そこで、これらの対策として、第3回の部分所 頭に示すように、電流増子2 と冷却ブロック3 と の間に、ベリリアとかポロンナイトライド(BN)な どの無伝導性の良好な絶難版8 を介在させて、電 気経路と冷却経路とを絶難した構成が提案されて いる。なお、この場合。絶益版8 の厚さは、おい よそ 0.5~1.5mm 程度が一般的である。

そして、この第3回従来倒續成の場合、半導体 第子1 に生ずる発施は、電波線子2,絶錯板8。およ び冷却プロック3 を経て冷却水に伝染吸収される が、電波線子2 と冷却プロック3 間の絶疑耐電圧 を十分に確保するために絶疑板8 の外別を大きく させて、その治頭距離を可及的に延長させるよう にしている。

しかし一方。冷却水を用いる上では、絶縁板 8 の支配での結算問題を避けることはできず、この

すなわち、この発明では、電波増子と冷却プロック間に絶縁板を挿入介在させることにより、電気経路と冷却経路を完全に絶縁でき、併せて装置全体を絶縁材料で対止させることにより、絶縁板面の結算などを認止し得て、電気経路と冷却経路間の耐電圧を格段に向上できるのである。

(実 第:例)

以下、この是明に係る半導体装置の一笑施例に つき、第1回を参照して詳細に最明する。

第1回はこの実施側による半導体装置の展更構成を示す解析型であり、この第1回実施側において、前記第2回。第3回要来側と四一符号は四一または相当部分を示している。

十なわち、この第1間変集例においても、符号 1 は半導体変子、ことではダイオードを示し、2 はこの半導体変子1 の両端側に配した一分の電波 場子、1 はさらにこれらの各電波域子の外側に配 した例などの熱保導性の良好な会異からなる一分 の内却ブロックで、それぞれの内質には、冷却水 の水坊もが別点され、各水路には、美調などの会



裏からなるホースニップル5 をねじ込みまたはロー付けにより取付けると共に、一方のニップル5。5 間を配 ホース4 により連結させ、他方のニップル5。5 を重して、矢印のように冷却水を造水させ、前記半導体第子1 の発施を、これら一対づいの電波編子2。2 および冷却プロック3。3 を介して冷却し得るようにしてある。

また、8 はアルミナ・変化アルミニウムとか、ポロンナイトライドなどの、熱伝導性の良好な覚気絶疑材料からなる絶疑版であつて、前記各電差は子2 と冷却プロック3 との間に介在・挿入されており、この絶疑版8 の厚さは、強常の場合。その耐電圧によつて決定されるが、 0.5~1.5mm 程度の範囲が一般的である。

さらに、8 は前記名部品相互を加圧挟持させる ための加圧構造部であり、8eは規定の圧挟力を与 えるための板ベネ、9bはこの圧接力を保持するた めのボルトである。

そしてまた。10は前記各電装編子2 の外部への 装載部分2mと、前記各階部プロック3 の外部への

傾され、電気経路。冷却経路間の高耐圧化が可能 になり、これらによつて、使来。純水を使用しな ければならなかつた起高圧の半導体装置をも容易 に実現し得るのである。

なお、前記実施例構造においては、水冷式の半 事件装置に適用する場合について述べたが、その 他・自冷式とか異冷式などの任意の冷却方式によ る半導件装置に適用しても阿様な作用。硬化が将 られる。そしてまた、この実施例構造では、半導 体索子を1個だけ用いる場合について述べたが、 これを複数個組合せて用いる場合にも広く適用で きることは初論である。

(発明の角果)

以上群逸したように、この発明によれば、半部体素子の両額に電波組子。冷却ブロックをそれぞれ眼次に重ね、かつこれらの相互を加圧構造器により加圧技神して構成する半部体装置構造において、各電波組子と冷却プロックとの放圧循関に始級を介在。挿入させて、電気的に絶談すると共に、各電波組子の外部への始級部分と、各冷却ブ

然伝達部分5aとを飲き、かつ前記加圧構造部8の 全体を含んで、これらを外部に対して被覆針止す るための、例えば、エポキシ機能、ゴムなどの絶 続材料からなる針止外数である。

しかして、この実施側構造の場合。半導体素子 しからの発生無は、その阿爾何での電波維子2.絶 縁板5.および冷却プロック3 を緩て、冷却水によ り吸収排除され、所期の半導体素子1 の冷却作用 が果されるのであり、この際の風伝導為中は、絶 緩板5 の介在による優かな影響のみであつて、大 相に悪くはならず、宝気緩散5 が介充さ れているために、電気緩散5 が電気的 に絶縁されて、冷却水には帯電せず、従つて冷却 水の水質管理が不要になり、かつ電波腐食を生ず る低れもない。

さらに、外部での接続部分2a。および外部への 然伝達部分5aを除き、かつ加圧構造部8を含んだ 全体を、絶縁材料からなる対止外数10により対止 させているために、絶縁板8の変態に生ずる結常 を防止できて、変調質での流れ電波が効果的に抑

4. 図図の簡単な影明

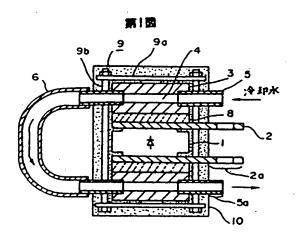
第1回はこの発明に係る半導体装置の一変施例 による概要構成を示す接新機関であり、また第2 回、および第3回は同上装置の従来例による概要 構成をそれぞれに示す業新機関である。

1 ・・・半導体素子、2 ・・・・電波線子、3 ・・・冷 ボブロック、4 ・・・・水路、8 ・・・ 始線板、8 ・・・ 加圧構造部、3a・・・板パネ、8b・・・加圧ポルト、 10・・・対止外凸上層短板体。

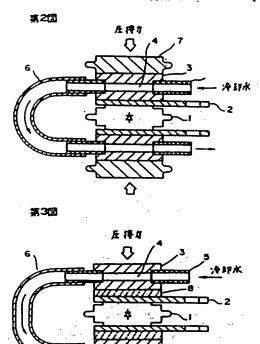




特開昭63-96946(4)



1 : 年集体条3 2 : 電波線3 3 : 冷却アロッ7 4 : 水路 8 : 紀経線 9 : 加及標準 9a: 板ボネ 9b: 加及ボル 10: 対止外装



THIS PAGE BLANK (USPTO)